

731956-2026 - Kilpailu

Saksa – Materiaalien lämpökäsittelykoneet – Hochtemperatur/ LP-CVD System für Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie
OJ S 205/2026 22/10/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä Tavarahankinnat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Westsächsische Hochschule Zwickau

Sähköposti: Beschaffungswesen@whz.de

Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö, joka on alueviranomaisen määräysvallassa

Pääasiallinen toimiala: Koulutus

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Hochtemperatur/ LP-CVD System für Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie

Kuvaus: Hochtemperatur/ LP-CVD System für Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie

Menettelyn tunniste: ec331272-b018-457b-b755-33fff05b1bf7

Sisäinen tunniste: OV 16-26

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 42940000 Materiaalien lämpökäsittelykoneet

Lisäluokitus (cpv): 42000000 Teollisuuskoneet, 42942000 Unit ja lisävarusteet

2.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: Peter Breuer Straße 11

Postitoimipaikka: Zwickau

Postinumero: 08056

Maaryhmittely (NUTS): Zwickau (DED45)

Maa: Saksa

2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: #Bekanntmachungs-ID: CXP4D4ZMW2D#

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

vgv -

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Hochttemperatur/ LP-CVD System für Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie

Kuvaus: 1 STK Hochttemperaturanlage mit 8 Prozessstationen / Rohren mit Beladeeinrichtungen für Hochttemperatur- und LP-CVD Prozesse, vorwiegend für monokristalline Siliziumwafer. - Footprint der Gesamtanlage nicht größer als 400cm x 600cm x 295cm (L x B x H). - Besteht das Gesamtsystem aus mehreren Einzelanlagen / Teilen müssen alle Anlagen innerhalb des angegebenen Footprints aufgestellt werden können. - Vom angegebenen Footprint ausgenommen sind ausschließlich eine etwaige Bedienkonsole, diese darf separat auf einem max. 180cmx80cm messenden Tisch untergebracht werden und die Vakuum-Pumpen, welche innerhalb eines Service-Bereichs untergebracht werden dürfen. - Bei zwei gekoppelten Einzelanlagen: ist eine an der Rückwand gespiegelte Konfiguration (eine Anlage mit Beladestationen rechts, eine Anlage mit Beladestationen links) vorzusehen - Alle 8 Prozessstationen sind auf die parallele Bearbeitung von mindestens 13 Stück Wafer pro Prozess auszulegen. - Die verarbeitbaren Durchmesser der Wafer sind mindestens: ϕ 150mm und ϕ 100mm - Die Prozessstationen sind als horizontal angeordnete Prozessrohre mit jeweils einem Quarz- oder SiC-Rohr und jeweils einer automatischen/motorisierten Beladestation vorzusehen. - Der Ausleger (Paddle) zur Beladung ist aus Siliciumcarbid auszuführen. - Die Beladestation(en) sind mit Luftfiltereinheit(en) mit laminarer Luftströmung vorzusehen. - Jede Prozessstation ist mit jeweils mindestens 3 Temperaturregelzonen pro Prozessrohr auszuführen. - Jedes LP - CVD Prozessrohr ist mit einem integrierten Leckratetest / Druckverlustprofiling zu realisieren. - Innerhalb der Bearbeitungszone der min. 13 Prozesswafer (Flat-Zone) ist im Prozess eine Temperaturabweichung vom Sollwert von höchstens ± 1 K und eine Soll-Temperaturabweichung von Run zu Run höchstens ± 1 K zu erzielen. - Mindestens ein geeignetes Thermoelement pro Temperaturregelzone zur Prozessüberwachung und -regelung muss vorhanden sein. - Mindestens ein geeignetes Thermoelement pro Temperaturregelzone als Ausfallsicherung muss vorhanden sein. - Mindestens ein Profilthermoelement pro Prozessstation - Geeignete Messeinrichtungen zur Anlagenüberwachung und Steuerung in Bezug die technische Sicherheit (z.B. Übertemperaturabschaltung, Abluftausfall, Kühlwasserausfall, Gasversorgungsausfall, redundante Interlocks...) müssen vorhanden sein. - In den Gaskabinetten ist eine Prozessgaszuführung und -verteilung, Prozessgassteuerung und -überwachung nach Stand der Technik, abgestimmt auf die Eigenschaften der für die Prozessstationen spezifizierten Prozessgase und Flüssigkeiten zu realisieren. - Absaugung / Scavenger an der Prozessstation - Anlagensteuerung(en) mit Monitor und Benutzerschnittstelle, spätestens nach Ablauf der Garantie müssen alle Benutzer- und Servicelevel für die WHZ zugänglich dauerhaft sein werden - mehrere Prozessstationen können in einer Steuerung/Benutzerschnittstelle zusammengefasst werden - Bei Störung muss die Anlage selbsttätig in einen sicheren Zustand übergehen, wenn dazu eine unterbrechungsfreie Stromversorgung notwendig ist, ist diese mit zu inkludieren. - Maschinen Not-Aus Schalter, gesichert gegen Wiederanschalten - CE Zertifikat und CE Kennzeichnung für Gesamtanlage - Einhaltung der EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EC / oder 2023/1230, je nach Auslieferungsdatum), wo anwendbar - Vollständige Anlagendokumentation. 1 STK Prozessstation, Oxidation, n-Typ-Substrate - Dauerprozesstemperatur mindestens 1050°C - Quarz oder SiC Prozessrohr - Komplettes Gaszufuhrsystem mit Massenstromregelung für: Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Dichlorethylen mit N2 Trägergas - Wasserstoff/Sauerstoff-Verbrenner zur Erzeugung von H2O und Injektion in den Ofen ("External Torch"), Überwachung und Sicherheitseinrichtungen nach Stand der Technik - Automatisiert, über die Anlage angesteuerter Bubbler mit Temperierung für 1,2-Dichlorethylen, 1500mL "Fuji"- kompatibel

oder mitgelieferter Quarzbubblor. - Quartz Baffle / Diffusor, falls zur Erreichung der von Lieferer zu spezifizierenden Homogenität nötig 1 STK Prozessstation, Oxidation, p-Typ Substrate - Dauerprozessstemperatur mindestens 1050°C - Quarz oder SiC Prozessrohr - Komplettes Gaszufuhrsystem mit Massenstromregelung für: Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Dichlorethylen mit N2 Trägergas - Wasserstoff/Sauerstoff-Verbrenner zur Erzeugung von H2O und Injektion in den Ofen ("External Torch"), Überwachung und Sicherheitseinrichtungen nach Stand der Technik - Automatisiert, über die Anlage angesteuerter Bubblor mit Temperierung für 1,2-Dichlorethylen, 1500mL "Fuji"- kompatibel oder mitgelieferter Quarzbubblor. - Quartz Baffle / Diffusor, falls zur Erreichung der von Lieferer zu spezifizierenden Homogenität nötig 1 STK Prozessstation, n-Dotierung - Prozessstemperatur mindestens 1000°C - Quarz oder SiC Prozessrohr, Phosphoroxychlorid Injektor und kompatibler Abgasstrang - Komplettes Gaszufuhrsystem mit Massenstromregelung für: Stickstoff, Sauerstoff und Phosphoroxychlorid mit N2 Trägergas - Bubblor für Phosphoroxychlorid, 1500mL "Fuji"- kompatibel oder mitgelieferter Quarzbubblor. - Baffle für Phosphoroxychlorid, dieser kann in Tür integriert sein, falls zur Erreichung der von Lieferer zu spezifizierenden Homogenität nötig - Separate Abgasführung mit Abscheider /Kondensor für Phosphorsäure 1 STK Prozessstation, p-Dotierung - Prozessstemperatur mindestens 1050°C - Quarz oder SiC Prozessrohr - Komplettes Gaszufuhrsystem mit Massenstromregelung für: Stickstoff, Sauerstoff, BBr3 mit N2 als Trägergas - BBr3 Injektor und kompatibler Abgasstrang - Bubblor für BBr3, 1500mL "Fuji"- kompatibel oder mitgelieferter Quarzbubblor. - Baffle für BBr3, falls zur Erreichung der von Lieferer zu spezifizierenden Homogenität nötig 1 STK Prozessstation, Oxidation - Dauerprozessstemperatur mindestens 1050°C - Quarz oder SiC Prozessrohr - Komplettes Gaszufuhrsystem mit Massenstromregelung für: Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Dichlorethylen mit N2 Trägergas
Sisäinen tunniste: OV 16-26

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 42940000 Materiaalien lämpökäsittelykoneet

Lisäluokitus (cpv): 42000000 Teollisuuskoneet, 42942000 Unit ja lisävarusteet

5.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: Peter Breuer Straße 11

Postitoimipaikka: Zwickau

Postinumero: 08056

Maaryhmittely (NUTS): Zwickau (DED45)

Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 60 Viikkoa

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Preiskriterium

Kuvaus: Preiskriterium

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 30

Kriteeri:

Tyyppi: Laatu

Nimi: Erfüllung der Leistungsparameter

Kuvaus: Erfüllung der Leistungsparameter

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 60

Kriteeri:

Tyyppi: Laatu

Nimi: Lieferzeit

Kuvaus: Lieferzeit

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 10

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 19/11/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika,

Länsi-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMW2D/documents>

Tilapäinen viestintäkanava:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMW2D>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMW2D>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 26/11/2026 09:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 83 Päivät

Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen :

Hankkijan harkinnan mukaan osa puuttuvista hakuasiakirjoista voidaan toimittaa myöhemmin.

Lisätiedot: Angebote dürfen nicht nachgefordert werden.

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei vielä tiedossa

Sähköinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Vergabekammer des Freistaates Sachsen

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Westsächsische Hochschule Zwickau

Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer des Freistaates Sachsen

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Westsächsische Hochschule Zwickau

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Westsächsische Hochschule Zwickau

Rekisterinumero: 14-1215011WHZ01-34

Postiosoite: Kornmarkt 1

Postitoimipaikka: Zwickau

Postinumero: 08056

Maaryhmittely (NUTS): Zwickau (DED45)

Maa: Saksa

Sähköposti: Beschaffungswesen@whz.de

Puhelin: 03755361130

Internetosoite: <https://www.whz.de>

Hankkijaprofiili: <https://www.whz.de>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Vergabekammer des Freistaates Sachsen

Rekisterinumero: ohne

Postitoimipaikka: Leipzig

Postinumero: 04013

Maaryhmittely (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)

Maa: Saksa

Sähköposti: vergabekammer@lds.sachsen.de

Puhelin: +49 03419773800

Tämän organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83

Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Tämän organisaation roolit:
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunnisteversio: ae5fd26c-1fae-40c3-b473-c6ce79dd8997 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyypinumero: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 21/10/2026 08:45:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa
Ilmoituksen julkaisunumero: 731956-2026
EUVL S -lehden numero: 205/2026
Julkaisupäivä: 22/10/2026